

國立陽明交通大學奈米中心
介電性材料活性離子蝕刻系統(RIE)委託代工申請單/報價單

製表日期:2020/06/24

委託者姓名:_____指導教授或主管姓名:_____

電話:_____傳真:_____手機:_____

E-Mail:_____

使用單位:☐學校單位_____大學_____ (系)所

☐其他 _____統一編號(公司專用):_____

連絡地址:_____郵遞區號:_____

製程參數:☐按中心製程參數 ☐自行設計 (於下表特殊製程條件說明)

蝕刻機台:☐Poly-RIE ☐RIE 200L ☐HDP RIE ☐P5000E ☐DEEP RIE ☐RIE-400iP

基本資料說明:(送件前請先與機台管理人員討論製程可能性)

請於下列表格寫明蝕刻薄膜種類與厚度、光阻厚度、硬烤條件及製程條件

基板種類及尺寸:

蝕刻薄膜製作來源設備:

編號	蝕刻膜材料	蝕刻深度	光阻厚度	光阻硬烤條件	特殊製程條件	備註

貴儀預約序號:_____	片數: 片	時數: 小時	收據號碼:_____
(委託代工)技術服務費合計:新台幣_____元整			
(不含營業稅, 如有其他稅賦及手續費由委託單位負擔)			

特別注意事項:

希望完成時間:_____有關結果之進一步解釋或討論:☐需要 ☐不需要

備註:

1. 本服務無研發成果產出, 不涉及智權歸屬。
2. 因本技術服務案所生之任何損害, 國立陽明交通大學僅因故意或重大過失負擔損害賠償責任, 並以本訂購單金額為賠償上限。
3. 付款條件:依委託單位現金付款方式支付, 匯費、郵費不得自貨款中扣除。
4. 交貨期限:依本訂單交件日期。
5. 交貨方式:現場取樣或郵寄樣品。
6. 未經本校書面同意, 不得引用陽明交通大學校名、校徽或其他表徵方式進行商業宣傳或其他商業及法律用途。如有違反願對陽明交通大學負損害賠償等相關法律責任。
7. 此報價單為委託代工所產生之技術服務費(委託完成後,奈米中心會另發出繳款通知單), 預約使用貴重儀器之儀器使用費由貴儀中心mail通知繳款費用。

奈米中心簽章:

委託者同意以上報價資料, 並清楚相關資訊, 委託者簽章:_____ (需包含日期)

委託單位戳章(公司企業者需核章):

儀器管理人:胡進章先生/電話:03-5712121分機55607 mail: jackhu@nycu.edu.tw

李正維先生/電話:03-5712121分機55660 mail: cwlee@nycu.edu.tw

儀器管理人簽章:_____收件人簽章:_____ (取件時簽收)